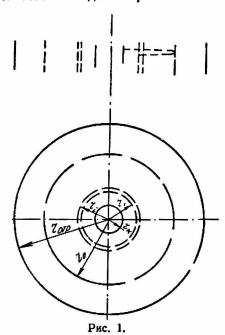
ЗАВИСИМОСТЬ ПАРАМЕТРОВ РАДИАЛЬНОГО ОТРАЖАТЕЛЬНОГО КЛИСТРОНА ОТ КРИВИЗНЫ ЭЛЕКТРОДОВ

А. И. Терещенко, А. Ф. Гребенюк

Харьков

В литературе описан целый ряд приборов клистронного типа с использованием дискообразного потока электронов [1—5 и др]. Однако,



несмотря на то, что первые патенты были выданы 30 лет назад, сведений о промышленном производстве генераторов и усилителей подобных конструкций нет. Как указывалось в работе [6], наиболее вероятными причинами этого являются недостаточная разработка инженерных методов расчета резонатора и практически полное отсутствие исследований по электронике радиальных клистронов.

На основании теоретических и экспериментальных исследований в работах [7, 8] вопрос о расчете кольцевых резонаторов сложного поперечного сечения можно считать решенным.

В настоящей работе рассматривается влияние кривизны электродов на параметры радиального отражательного клистрона.

Схема расположения электродов исследуемого прибора показана на рис. 1. Здесь r_{κ} — радиус катода; r_{1}

и r_2 — радиус первой и второй сеток, $r_{\rm orp}$ — радиус отражателя. Цилиндрическая поверхность радиуса r_0 , соответствующая нулевому потенциалу, обозначает место остановки электронов и начала их движения в обратном направлении.

Введем следующие упрощающие предположения:

- 1. Время пролета электронов в зазоре между сетками мало по сравнению с временем пролета в области группировки.
- 2. Сетки прозрачны для электронов, но непрозрачны для высоко частотного поля.
- 3. Влияние пространственного заряда и разброс скоростей электронов при вылете из катода не учитываются.

Поскольку в первом приближении задачу можно считать одномерной, уравнение движения электрона будет

$$\ddot{r} = \frac{e}{m} \frac{\partial U}{\partial r} \,, \tag{1}$$

где U = U(r) — потенциал в междуэлектродном пространстве;

е и т — заряд и масса электрона.

Используя выражение для распределения потенциала в цилиндрическом конденсаторе, получаем для цилиндрического диода с тормозяшим полем

$$U(r) = (U_{\text{orp}} - U_{c}) \frac{\ln \frac{r}{r_{c}}}{\ln \frac{r_{\text{orp}}}{r_{c}}} + U_{c}, \qquad (2)$$

где $U_{
m отр}$ — потенциал отражателя; $U_{
m c}$ — потенциал в середине зазора между сетками, т. е. в точке $r_{\rm c} = \frac{r_2 + r_1}{2}$.

Подставляя выражение (2) в (1), получаем

$$\ddot{r} = \frac{e}{m} \frac{1}{r} \frac{U_{\text{orp}} - U_{\text{c}}}{\ln \frac{r_{\text{orp}}}{r_{\text{c}}}}.$$
 (3)

В силу сделанного нами предположения о малости времени пролета электронов между сетками можно считать, что коэффициент эффективности взаимодействия для случая радиального клистрона будет таким же, как и у обычного линейного клистрона.

Для определения параметра группировки электронов необходимо найти время пролета электрона $t_{\rm np}$ от резонатора ($r=r_{\rm c}$) до поверхности возврата $(r=r_0)$ и обратно.

Заметим, что время прямого и обратного движения электрона одинаково, поскольку это движение происходит в одном и том же поле.

В результате двойного интегрирования уравнения (3) с учетом начальных условий

$$v = v_0$$
 при $r = r_c$; $v = 0$ при $r = r_0$

получаем

$$t_{\rm np} = \frac{4r_{\rm c}e^{-\frac{v_0^2}{a}}}{\int_{v_0}^{0} e^{\frac{\xi s}{a}} d\xi, \tag{4}$$

где

$$a = \frac{2e}{m} \frac{U_{\text{orp}} - U_{\text{c}}}{\ln \frac{r_{\text{orp}}}{r_{\text{c}}}};$$

$$\xi = \sqrt{\frac{v_0^2 + a \ln \frac{r}{r_{\text{c}}}}{r_{\text{c}}}}.$$

Найти интеграл в выражении (4) можно сведением его к табличному либо путем разложения подынтегральной функции в ряд Тейлора. Используя последний метод, имеем

$$t_{\rm np} = -\sqrt{\frac{m}{e}} \frac{2r_{\rm c}e^{-b} \ln \frac{r_{\rm orp}}{r_{\rm c}}}{U_{\rm orp} - U_{\rm c}} \sqrt{2U_{\rm c}} \left(1 + \frac{\ln \frac{r_{\rm orp}}{r_{\rm c}}}{3(U_{\rm orp} - U_{\rm c})} + \ldots\right), \quad (5)$$

где

$$b = \frac{U_{\rm c} \ln \frac{r_{\rm orp}}{r_{\rm c}}}{U_{\rm orp} - U_{\rm c}} \cdot$$

С целью проверки данного решения устремим $r_{\text{отр}}$ и $r_{\text{с}}$ в бесконечность при фиксированном расстоянии $r_{\text{отр}} - r_{\text{c}} = l$, т. е. будем разгибать систему. Тогда в формуле (5)

$$\ln \frac{r_{\text{opp}}}{r_{\text{c}}} = \ln \frac{r_{\text{c}} + e}{r_{\text{c}}} = \ln \left(1 + \frac{e}{r_{\text{c}}}\right) \Big|_{r_{\text{c}} \to \infty} = 0;$$

$$e^{b-} = e - \frac{U_{\text{c}} \ln \frac{r_{\text{opp}}}{r_{\text{c}}}}{U_{\text{opp}} - U_{\text{c}}} \Big|_{r_{\text{c}} \to \infty} = e^{0} = 1.$$

 $r_{\rm c} \ln \frac{r_{\rm orp}}{r_{\rm c}}$ даст неопределенность вида $\frac{0}{0}$. Раскрывая ее по правилу Лопиталя, получаем, что это выражение приводится к величине $r_{\rm orp}-r_{\rm c}=$ = l. Таким образом, вместо выражения (5) получаем

$$t_{\rm np} = -\sqrt{\frac{m}{e}} \frac{1}{U_{\rm emp} - U_{\rm c}} \sqrt{8U_{\rm c}}, \tag{6}$$

т. е. известную из литературы [9] формулу для случая обычного линейного отражательного клистрона.

Перепишем уравнение (4) в несколько ином виде, более удобном для вычислений. Для этого введем новую переменную

$$X_{1,2}\pm \sqrt{-\frac{2}{a}};$$

тогда

$$t_{\rm np} = \frac{2r_{\rm c}e^{-\frac{U_{\rm c} \ln \frac{r_{\rm orp}}{r_{\rm c}}}{U_{\rm orp} - U_{\rm c}}} \sqrt{\frac{1}{\ln \frac{r_{\rm orp}}{r_{\rm c}}}} \sqrt{\frac{m}{l}} \sqrt{\frac{2\pi}{2}} \frac{2}{\sqrt{2\pi}} \int_{0}^{\tau} e^{-\frac{x^{2}}{2}} dx.$$
 (7)

Величина

$$\frac{2}{\sqrt{2\pi}} \int_{0}^{\tau} e^{-\frac{x^{2}}{2}} dx = \Phi(\tau) -$$
 (8)

табулированный [10] интеграл вероятности.

Верхний предел интегрирования

$$\tau = \sqrt{-\frac{2 \ln \frac{r_{\text{orp}}}{r_{\text{c}}} U_{\text{c}}}{U_{\text{orp}} - U_{\text{c}}}} = f\left(U_{\text{orp}}; \ U_{\text{c}}; \ \frac{r_{\text{orp}}}{r_{\text{c}}}\right).$$

Задавая конкретные значения геометрических размеров r_c и $r_{\text{отр}}$ и напряжений на электродах, можно вычислить интересующее нас время пролета. Однако для анализа более удобно сравнить его в общем виде с временем пролета в линейном отражательном клистроне. С этой целью перепишем выражение (7) в виде

$$t_{\text{np. p}} = 2 \sqrt{\frac{m}{e}} \frac{(r_{\text{opp}} - r_{\text{c}}) \sqrt{2U_{\text{c}}}}{-U_{\text{opp}} + U_{\text{c}}} \times \frac{r_{\text{np. 1}}}{r_{\text{np. 1}}}$$

$$\times \underbrace{\frac{r_{c}e^{-\frac{U_{c}\ln\frac{r_{corp}}{r_{c}}}{U_{orp}-U_{c}}}\sqrt{\frac{\ln\frac{r_{orp}}{r_{c}}}{\ln\frac{r_{orp}}{r_{c}}}\sqrt{\frac{2U_{c}(r_{orp}-r_{c})2}{\Phi(\tau)}}}_{F(\tau)} \Phi(\tau). \tag{39}$$

Таким образом, время пролета в радиальном клистроне равно произведению времени пролета в линейном клистроне на некоторый коэффициент $F(\tau)$, учитывающий влияние кривизны электродов. Зависимость

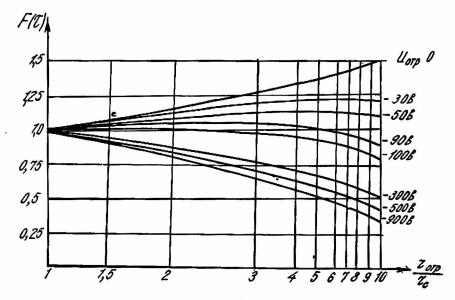


Рис. 2.

этого коэффициента от величины отношения $\frac{r_{\rm orp}}{r_{\rm c}}$ для ряда значений напряжения на отражателе при фиксированном ускоряющем напряжении $U_{\rm c}=300~s$ показана на графике рис. 2. Из решения видно, что при небольших отрицательных напряжениях на отражателе время пролета электрона в радиальном клистроне больше, а при больших отрицательных напряжениях — меньше, чем в случае линейного клистрона.

Физическое объяснение этого явления легко сделать на основании графика рис. 3, показывающего картину распределения потенциала между цилиндрическими (сплошные) и плоскопараллельными электродами (штриховые линии).

Поскольку в зависимости от величины отношения $\frac{r_{\text{отр}}}{r_{\text{c}}}$ и от напряжения $U_{\text{отр}}$ коэффициент $F\left(\tau\right)$ может быть либо меньшим, либо большим единицы, он вносит изменения в величину угла пролета $\Theta_{\text{sr}}=\omega t_{\text{пр}}$ и параметра группировки.

Поэтому такие параметры радиального клистрона, как отдаваемая в нагрузку мощность

$$P_{\mathbf{B}} = \frac{2I_0 U_{\mathbf{c}}}{\Theta_{\mathbf{s}\phi} F(\tau)} \left[XI_1(X) - \frac{G_{\mathsf{pes}} X^{\mathbf{s}}}{F(\tau) \frac{I_0}{U_{\mathbf{c}}} M^{\mathbf{s}\Theta_{\mathbf{s}\phi}}} \right]$$

и диапазон электронной настройки

$$\delta = \frac{F(\tau) \frac{I_0}{U_c} M^2 \Theta_{9\phi}}{2\omega_0 C} A(X),$$

гдe

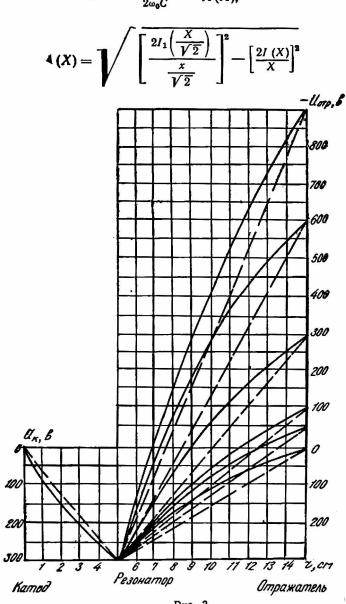


Рис. 3.

 $(I_1$ — функция Бесселя первого рода) могут быть больше или меньше, чем у линейного клистрона. Учитывая различный характер зависимости этих параметров от $F(\tau)$ (в формуле для P_+ этот коэффициент входит в знаменатель, а в формуле для δ — в числитель), можно соответствующим выбором геометрии и электрического режима работы радиального клистрона расширять диапазон электронной настройки, либо увеличивать отдаваемую прибором мощность.

ЛИТЕРАТУРА

- 1. W. W. Hansen, R. H. Varian and J. R. Woodyard. Патент США № 2.259.690 or 20/IV. 1939.
 - 2. J. Müller. Немецкий патент № 739.206 от 10/VI 1939.
 - 3. G. V. Litton. Патент США № 2.298.949 от 20/IV 1940.
 - 4. G. Веz v. Французский патент № 871.924 от 16/VI. 1940.
- 5. Н. Д. Девятков, М. Л. Слиозберг и Е. Н. Данильцев. Авт. свид. № 61000 от 11/ХІ 1940.
- 6. А. И. Терещенко. Сб. «Радиотехника», вып. 3. Изд-во ХГУ, Харьков, 1966.
- 7. А. И. Терещенко, А. Ф. Зоркин. «Радиотехника и электроника», 9. № 7, 1206, 1964.
- 8. А. Ф. Зоркин, А. И. Терещенко. Сб. «Радиотехника», вып. 2. Изд-во ХГУ. Харьков, 1966.
- 9. И. В. Лебедев. Техника и приборы сверхвысоких частот. Изд-во «Энер-
- гия», М. Л., 1964.
 - 10. Е. Янке и Ф. Эмде. Таблицы функций. Физматгиз, 1959.